

HITACHI

最高分解能×高スループット×自動/省力化 FE-SEM



超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡

SU9600

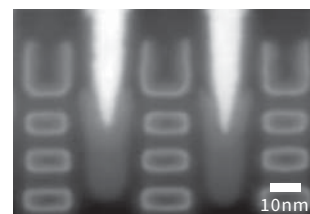
Ultra-high-Resolution
Scanning Electron Microscope

特長

- ▶ 日立独自技術のインレンズSEMが実現する高分解能観察
- ▶ 効率性と高解像度を両立する次世代撮像機能
- ▶ 各種機能による自動化、省力化



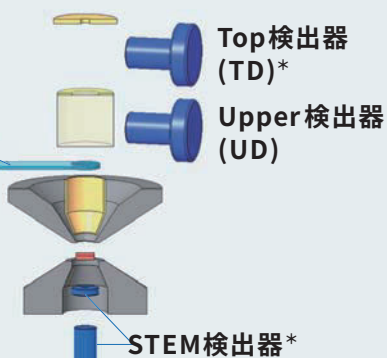
試料: SRAM
(GAA構造断面)
加速電圧: 7 kV
倍率: 1,000 kX



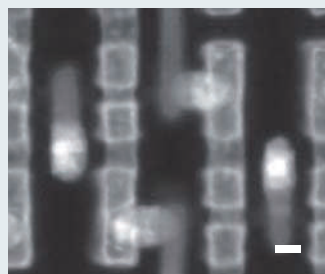
新しいフラッグシップモデル「SU9600」誕生。

検出器紹介

シンチレータ型
反射電子検出器(VCD)*
VCD: Variable Crystal Detector



SRAM表面からの内部構造観察(BSE)



加速電圧: 30 kV
倍率: 700 kX

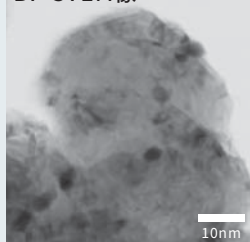
グラファイト触媒の表面観察事例(SEモード)



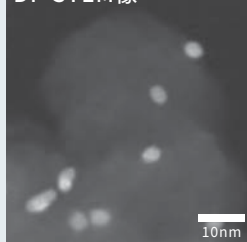
加速電圧: 30 kV
倍率: 1200 kX

グラファイト触媒の透過観察事例

BF-STEM像



DF-STEM像



加速電圧: 30 kV
倍率: 1200 kX

* オプション



日立ハイテク“SI NEWS”公式Facebookページ
<https://www.facebook.com/HitachiHighTechnologies.SINEWS>

SI NEWSは、弊社製品を使用した社内外の研究論文を中心に、先端の研究動向・技術情報をご紹介します。技術機関誌です。Facebookページでは、本誌内容のご紹介を中心に、皆さまのご研究に役立つ情報をタイムリーに発信してまいります。



株式会社 日立ハイテク

本社 〒105-6409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 電話03-3504-6111
<https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/products/microscopes/>